#### **PCT**

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



### INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4:

G01B 11/02, 11/24

A1

- (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 88/ 10406
- (43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

29. Dezember 1988 (29.12.88)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP88/00541

(22) Internationales Anmeldedatum: 21. Juni 1988 (21.06.88)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

2427/87-1

(32) Prioritätsdatum:

26. Juni 1987 (26.06.87)

(33) Prioritätsland:

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):
BATTELLE-INSTITUT E.V. [DE/DE]; Am Römerhof 35, D-6000 Frankfurt am Main 90 (DE).

(72) Erfinder; und

(72) Erinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STRÄTER, Hans-Dieter [DE/DE]; Hedderichstrasse 38, D-6000 Frankfurt 38 (DE). GROSS, Daniel [CH/CH]; 40, rue des Acacias, CH-1227 Carouge (CH). JAUCH, Karl, Martin [CH/CH]; 4, avenue du Lignon, CH-1219 Le Lignon (CH).

(74) Anwalt: SARTORIUS, P.; Am Römerhof 35, D-6000 Frankfurt am Main 90 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), CR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: DEVICE FOR MEASURING DISTANCES BETWEEN AN OPTICAL ELEMENT WITH HIGH CHRO-MATIC ABERRATION AND AN OBJECT

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR MESSUNG VON ABSTÄNDEN ZWISCHEN EINEM OPTISCHEN ELE-MENT MIT GROSSER CHROMATISCHER ABERRATION UND EINEM GEGENSTAND

#### (57) Abstract

In a process for measuring the profile of an irregular reflecting surface as a function of the distance between each point of this profile and a polychromatic light source, a flat beam of light is produced from the light from this source, for example, and represented on the profile by a chromatic lens element. The height of the profile is derived from the differentially coloured light strips so formed. The relief of the object is reconstructed by analysis with a spectral dispersion apparatus.

#### (57) Zusammenfassung

Das Verfahren dient zur Profilvermessung einer unebenen, reslektierenden Obersläche in Abhängigkeit von dem Abstand zwischen jedem Punkt dieses Profils und einer polychromatischen Lichtquelle. Hierzu wird z.B. ein flaches Lichtbündel aus dem Licht dieser Quelle gebildet und mit einem chromatischen Linsenelement auf das Profil abgebildet. Dieses führt zu einem farblich differenzierten Lichtstreifen, der die Profilhöhe wiedergibt. Die <u>5</u>

Analyse mit einer spektraldispersiven Apparatur rekonstruiert das Höhenprofil des Gegenstandes.

# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

TA	Österreich	FR	Frankreich		******
ďΑ	Australien	GA	Gabun	MR	Mauritanien
BB	Barbados			MW	Malawi
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
		HU	Ungarn	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	П	Italien	RO	Rumānien
BJ	Benin ·	Ъ	Japan	SD	
BR	Brasilien	KP	Demokratische Volksrepublik Korea		Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik			SE	Schweden
CG	Kongo	KR	Republik Korea	SN	Senegal
		LI	Liechtenstein	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CM	Kamerun	LU	Luxemburg	TG	
DE	Deutschland, Bundestepublik	MC	Monaco		Togo
DK	Dinemark	-		US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MG	Madagaskar		
	* 11111191161	MI	Mali		

Vorrichtung zur Messung von Abständen zwischen einem optischen Element mit grosser chromatischer Aberration und einem Gegenstand.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Messung von Abständen zwischen einem optischen Element mit großer chromatischer Aberration und einem Gegenstand, wobei von einer Lichtquelle ausgehendes weißes Licht durch das optische Element auf den Gegenstand abgebildet wird, der einen Bruchteil des einfallenden Lichtes zurückwirft, der auf eine spektraldispersive Apparatur abgebildet wird.

Man hat schon in der US-PS 4,585,349 vorgeschlagen, die fernung eines Punktes der reflektierenden Oberfläche, der auf optischen Achse der Meßvorrichtung liegt, optisch zu Bündelung der auf basiert Messung Diese messen. polychromatischen Lichtes, dessen jeweilige Bündelungsentfernung charakteristisch für die Wellenlängen ist. fangen des Lichtes, das von dem auf der optischen Achse gelegenen Teil der zu messenden Oberfläche reflektiert wird, Intensitätsmaximum für die Wellenlänge, ein man charakteristisch für die Entfernung dieses Teils der reflektierenden Oberfläche ist. Um diese Messung durchzuführen, leitet man das reflektierte Licht auf ein Beugungsgitter, es nach seinen verschiedenen Wellenlängen streut, ermittelt mit Hilfe einer Reihe optischer Meßzellen, die Wellenlänge mit der größten empfangenen Lichtintensität Der Brennpunktabstand dieser Wellenlänge entspricht der Entfernung zwischen der holographischen Linse zur Fokussierung reflektierenden Lichtes und der polychromatischen Oberfläche. Diese Lösung ermöglicht zwar die Messung der Entfernung eines Punktes, aber nicht die Profilabbildung der Oberfläche, was ihren Anwendungsbereich ganz erheblich begrenzt.

Ferner ist ein herkömmliches optisches Tiefenmeßverfahren bekannt, das auf der Wirkung der Parallaxe oder der Triangulation beruht, wobei ein Lichtbündel auf ein Objekt projeziert wird. Ein Detektor beobachtet diesen Punkt oder diese beleuchtete Linie unter verschiedenen Winkeln. Die Wirkung der Parallaxe ermöglicht die Berechnung der Entfernung der Oberfläche oder ihres Profils. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daß entweder der Lichtwinkel oder der Beobachtungswinkel oder beide schief sein müssen, so daß die Tiefe der Löcher oder Rillen, die beobachtet werden können, begrenzt ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, mit der ohne Bewegung von Sensor oder Prüfling von diesem ein Profil abgenommen werden kann. Diese Aufgabe ist durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Hierdurch wird es auf einfache Weise möglich, mittels mindestens zwei Lichtpunkten ohne mechanische Bewegung mehrere Messungen an verschiedenen Orten des Prüflings gleichzeitig durchzuführen und damit lineare Profilschnitte zu generieren. Ebenfalls ist es möglich, den Prüfling auf einen frei definierten Raster zu vermessen. Die Lichtpunkte können gemäß Anspruch 4 unterschiedlichen Abstand zur Hauptebene aufweisen, um dadurch einen vergrößerten Meßbereich zu erhalten oder eine höhere Meßgenauigkeit. In vorteilhafter Weise ergeben mehrere Lichtpunkte einen Lichtstreifen.

Durch die Anordnung gemäß der Ansprüche 5 und 6 lassen sich dem Prüfling angepaßte Kontroll- oder Meßpunkte definieren. Dadurch wird die Meßzeit minimiert. Durch die Verwendung von mehreren parallelen Lichtstreifen werden sehr viele Meßpunkte gleichzeitig erfaßt und somit eine flächenmäßige Abdeckung des Prüflings erreicht.

Gemäß den Ansprüchen 8 und 9 wird eine optimale Übertragung des reflektierten Lichtes an die spektral dispersive Apparatur erreicht und damit auch die Vermessung schwach reflektierender Prüflinge ermöglicht.

Durch die vorteilhafte Ausgestaltung der Vorrichtung gemäß Anspruch 11 und 12 wird eine kompakte und kostengünstige Bauweise ermöglicht. Die alternative Verwendung von Glaslinse und Zonenplatte ergibt einen über weite Bereiche variierbaren Meßbereich.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausführungswegen darstellenden Zeichnungen näher erläutert.

#### Es zeigen:

- Fig. 1 das Prinzip der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Messung eines linearen Profilschnittes;
- Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit Durchlichtgitter;
- Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel mit punktförmigen Lichtquellen.

In Abb. 1 wird eine polychromatische, streifenförmige Lichtquelle 1 mit breitem Spektrum gezeigt. Dieses Licht wird auf eine chromatische Linse 2 geleitet, die dazu dient, das Licht in Abhängigkeit von seinen verschiedenen Wellenlängen zu bündeln. Die zu vermessende reflektierende Oberfläche 3 wird in einer Entfernung p von der Linse 2 angebracht. Auf dieser Oberfläche 3 entsteht ein Bild, welches in jedem beleuchteten Punkt jeweils für eine Farbe scharf abgebildet ist, abhängig von der Entfernung der einzelnen Oberflächenpunkte von der Linse 2. Das gestreute Licht wird mit der chromatischen Linse 2 zurückabgebildet und über einen halbdurchlässigen Spiegel 4 auf den Eingangsspalt 7 einer spektraldispersiven Apparatur 5 gelenkt. Diese setzt die Wellenlängen-Information für jeden Punkt in eine Ortsinformation um, so daß sich am Ausgang der Apparatur 5 ein Profilbild der Oberfläche 3 ergibt, welches auf eine als Detektor benutzte Schwarz-Weiß-CCD-Flächen-Kamera 6 fällt.

Als chromatisches Element (Linse 2) kann eine Zonenplatte oder eine chromatisch nicht korrigierte Linse oder eine Kombination mehrerer Linsen zur Verstärkung des chromatischen Effektes benutzt werden.

Die Lichtquelle 1 kann durch ausgeleuchtete Spalte und, punktförmige Blenden oder geeignete Lichtleiter gebildet werden. Die Form der Lichtquelle kann ohne weiteres den Problemstellungen angepaßt werden. Neben der Verwendung Lichtstreifens gemäß Abb. 1 kann es vorteilhaft sein, mehrere Lichtflächenelemente oder Lichtstreifen 10 oder mehrere Lichtpunkte 12 in einem gewünschten Meßraster zu verwenden. speilsweise können zwei Lichtpunkte 12 in geeignetem Abstand Lichtpunkte auf den Ecken eines n-Ecks vorgesehen sein. Wenn das Profil der Oberfläche annähernd bekannt ist, ist es vorteilhaft, die einzelnen Lichtpunkte 12 oder Lichtflächenelemente (10) nicht in einer zur Hauptebene des Linsenelementes 10 parallelen Ebene anzuordnen, sondern für einzelne Lichtflächenelemente 10 unterschiedliche Abstände von der Linse 2 vorzusehen.

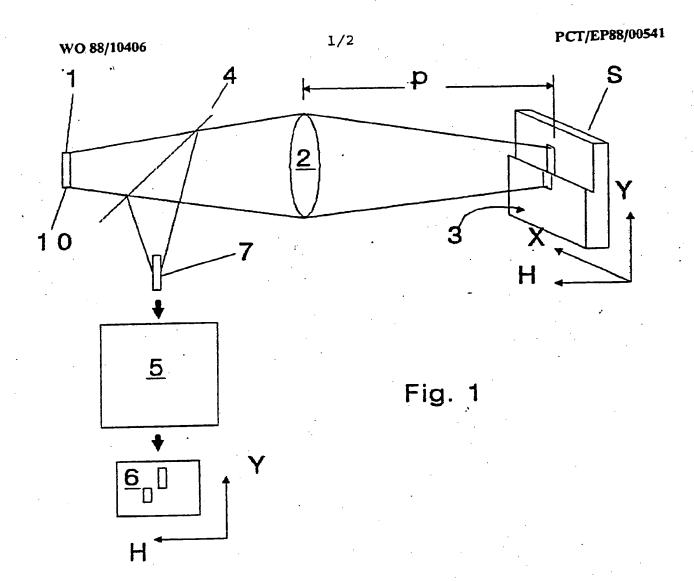
Neben dem in Fig. 1 gezeigten Prinzip der Auskopplung durch halbdurchlässigen Spiegel ist es vorteilhaft, ein einen Durchlichtgitter 8 direkt an der Linse 2 anzubringen, so daß dieses etwa die halbe Linsenfläche abdeckt (Fig. 2). Für beide Verfahren sind als dispersive Elemente Prismen, Gradsichtprismen und Gitter einsetzbar. Alternativ kann auch auf ein dispersives Element (Apparatur 5 oder Durchlichtgitter 8) verzichtet werden und das rückabgebildete Licht für jeden beleuchteten Punkt direkt auf ein Paar, in der Zeichnung nicht dargestellte, Fotodetektoren abgebildet werden, die für verschiedene Wellenlängen jeweils eine unterschiedliche Empfind-. lichkeit aufweisen. Die Zentralwellenlänge des reflektierten Lichtes wird dann aus dem Quotient der Signalhöhen der beiden Detektoren abgeleitet. Es wird dann für jeden Punkt auf der Oberfläche ein Detektorpaar benötigt.

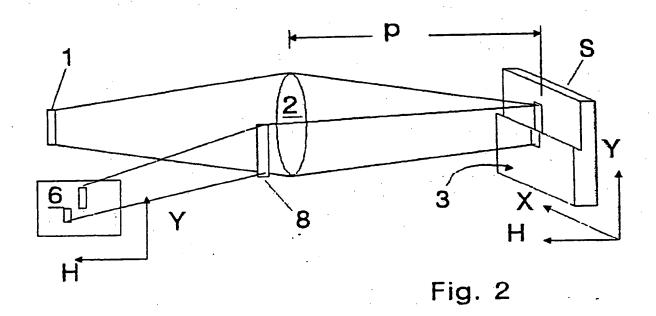
#### Patentansprüche

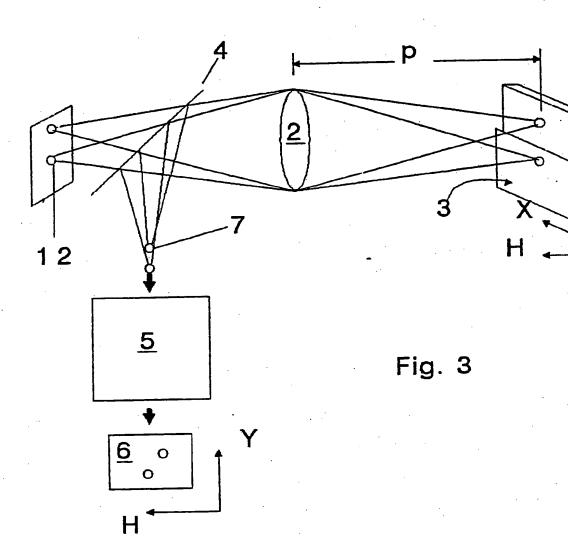
- 1. Vorrichtung zur Messung von Abständen zwischen einem optischen Element (2) mit großer chromatischer Aberration und einem Gegenstand (S), wobei von einer Lichtquelle (1) ausgehendes weißes Licht durch das optische Element (2) auf den Gegenstand (S) abgebildet wird, der einen Bruchteil des einfallenden Lichtes zurückwirft, der auf eine spektraldispersive Apparatur (5) abgebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (1) aus mindestens zwei Lichtpunkten gebildet ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Lichtpunkte in einer in etwa zur Hauptebene des optischen Elementes (2) parallel verlaufenden Ebene angeordnet sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Lichtquelle (1) aus mehr als zwei Lichtpunkten gebildet ist.

- 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Lichtpunkte mit unterschiedlichem Abstand zur Hauptebene des optischen Elementes angeordnet sind.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß mehrere Lichtpunkte einer Lichtquelle (1) beliebig zueinander in einer Ebene angeordnet sind.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Lichtpunkte auf einer Geraden, einem Dreieck, einem Rechteck bzw. auf den Eckpunkten eines beliebigen Polygons angeordnet sind.
- 7. Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Lichtquelle (1) aus einem oder mehreren Lichtstreifen (10) gebildet ist, die durch Blenden erzeugt werden.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß Breite und Länge der schlitzförmigen Lichtquelle (1) gleich oder annähernd gleich der Schlitzöffnung (7) einer spektraldispersiven Apparatur (5) ist.
- Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 8, <u>dadurch gekenn-zeichnet</u>, daß als Apparatur (5) ein Prisma oder ein Gradsichtprisma oder ein Beugungsgitter eingesetzt wird.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das vom Gegenstand reflektierte Licht über das optische Element (2) und einem zwischen diesem und der Lichtquelle (1) angeordneten halbdurchlässigen Spiegel (4) auf den Eingangsspalt (7) eines Spektralanalysators mit Geradsichtprisma abgebildet wird.

- 11. Vorrichtung nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß ein transparentes Beugungsgitter (8) zur winkelförmigen Streuung des vom Profil der besagten Oberfläche (3) reflektierten Lichtes gemäß den für die unterschiedlichen Wellenlängen charakteristischen Winkel und eine Empfangsoberfläche für die so erzeugte Abbildung vorgesehen sind, wobei die seitlichen Ablenkungen für die Entfernungen der verschiedenen Teile des besagten Profils entlang der optischen Achse charakteristisch sind.
- 12. Vorrichtung gemäß Anspruch 11, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das transparente Beugungsgitter (8) neben einer optischen Fokussierungsvorrichtungen angeordnet ist.
- 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das transparente Beugungsgitter eine Oberfläche aufweist, die im wesentlichen halb so groß ist wie die Oberfläche des optischen Elementes (2).
- 14. Vorrichtung gemäß Anspruch 11, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das optische Elemente (2) eine Glaslinse oder eine chromatische Linse vom Typ Zonenplatte enthalten, die konzentrische Beugungsringe aufweist, deren räumliche Frequenz in Richtung auf den Rand der Linse zunimmt.
- 15. Vorrichtung gemäß Anspruch 11, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die die Abbildung aufnehmende Fläche aus einem flachen CCD-Gitter (6) gebildet wird.







# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 88 /00541

I. CLASS	IFICATIO	N OF SUBJECT MATTER (If several classific	ation symbols apply, indicate all) 6	
According	to Internati	onal Patent Classification (IPC) or to both Nation	nal Classification and IPC	
Int.C	:1:	GO1B 11/02;G01B 11/24		
II. FIELDS	SEARCH	IED		
		Minimum Documenta		
Classification	n System	CI	assification Symbols	
Int.C	21.4	G01B		
		Documentation Searched other the to the Extent that such Documents a	an Minimum Documentation re included in the Fields Searched *	
			·	<u> </u>
	NENTS (	CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Cita	tion of Document, 11 with indication, where appro	opriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13
1		A, 0142464 (BATTELLE M		
P,Y	EP,	A, 0142464 (BATTEBBE F 22 May 1985 see abst	ract:figures	1
		& US, A, 4585349		
			•	·
Y	GB	, A, 2144537 (ISTITUTO	NAZIONALE DI	
-		OTTICA) 6 March 198	35	,
		see page 2,lines 26-7	75;figure 2	1
A				2,3,7,14
, "				
A	IEI	EE.Transactions on Patt Machine Intelligence, Nr. 2, March 1983, II R.A. Jarvis: "A pers	, vol. PAMI-5, EEE, (New York, US) Dective on range	1
·		finding techniques for pages 122-139	or computer Vision	<u> </u>
		see pages 127-128, par	ragraph V	1
			•/•	
	۲			
• Speci	lai categori	es of cited documents: 10	"T" later document published after or priority date and not in confi	the international filing date lict with the application but
#A# do	cument det	Fining the general state of the art which is not be of particular relevance	cited to understand the princip	
"E" ea	rlier docum	ent but published on or after the international	"X" document of particular relevant cannot be considered novel of	ce; the claimed invention cannot be considered to
	ing date icument wi	lich may throw doubts on priority claim(s) or	involve an inventive step	the claimed invention
wr	hich is cite lation of ot	her special reason (as specified)	CEUNDS DE COMPRESSO SO	or more other such docu-
l ot	her means	erring to an oral disclosure, use, exhibition or	ments, such compination being in the art.	OBMODE TO A POSSESS
"P" do	cument pu ler than the	blished prior to the international filing date but priority date claimed	"A" document member of the same	patent family
IV. CER	TIFICATI	ON		earch Report
Date of t	he Actual (	Completion of the International Search r 1988 (14.10.88)	Date of Mailing of this international S 31 October 1988	(31.10.88)
Internation	onal Search	ling Authority	Signature of Authorized Officer	
l .			}	
I POKO	PEAN	PATENT OFFICE		

# International Application No. PCT/EP 88/00541

III. DOCUI								
Category •	Citation of	Document, with indication, wh	ere appropriate; of ti	re relevant peeseg	<b>106</b>	Relevant to	Claim No	
A	IBM	IBM Technical Disclosure Bulletin, vol. 27,Nr. 12, May 1985, (New York, US) "Chromatic Focusing Technique" pages 6850-6851 see the whole document				1		
A	İBM	Technical Dis vol. 16,Nr. 2 US) J.R. Mal meter" pag	, July 19'	73, (New cal micro	York D <del>-</del>	1	•	
						•	. :	
	•							
						•		
			·					
•	· :.							
			•					
		·						
}		·	•		·			
•	,		. ,					
	•							
1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•					
		•	*					
	·							
				•				
		• •		•		•		
						-		
. .				•				
				•				
	•	•	·					
						•	•	
	· .	•			l			

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (January 1985)

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 8800541

-SA : 23156

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 24/10/88. The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
EP-A- 0142464	22-05-85	JP-A- 60073405 <u>US-A-</u> 4585349 CH-B- 663466	25-04-85 29-04-86 15-12-87	
GB-A- 2144537	06-03-85	FR-A,B 2550332 DE-A- 3428593	08-02-85 14-02-85	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 88/00541

	FIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind elle a	nzugeben) <sup>6</sup>
. KLASS	FIKATION DES ANMELDUNGSGEGENS (AND termationalen Klassifikation und der IPC er internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC	
Nach di	internationalen rateritatassimustassim	
	G 01 B 11/02; G 01 B 11/24	
I. RECHE	RCHIERTE SACHGEBIETE  Recherchierter Mindestprüfstoff <sup>7</sup>	
	K jestifikationsvmbole	
lassifikati	onssystem	
nt. Cl.4	G 01 B	
	1	
	Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>	
	unter die recherchief ten Congress	
		<u> </u>
II EINSC	HLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN <sup>9</sup>	Betr. Anspruch Nr.13
Art*	HLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN <sup>3</sup> Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> ,soweit erfordarlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Dett. Anapireon
P,Y	EP, A, 0142464 (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE)	1
	siehe Zusammenfassung; Figuren & US, A, 4585349	
Y	GB, A, 2144537 (ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA) 6. März 1985	1
.	siehe Seite 2, Zeilen 26-75; Figur 2	2,3,7,14
A	•••	
A	IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Band PAMI-5, Nr. 2, März 1983, IEEE, (New York, US),	1
	R.A. Jarvis: "A perspective on range finding techniques for computer vision", Seiten 122-139	
j	siehe Seiten 127-128, Absatz V	
. [		
1	•/•	
defi	ere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: öffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik niert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist res Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna- alen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach meldedatum oder dem Prioritätsdat ist und mit der Anmeldung nicht ke Verständnis des der Erfindung zu oder der ihr zugrundeliegendan The	om verorræntlicht worden blildiert, sondern nur zum grundeliegenden Prinzip: brie angegeben ist
"L" Ver zwe fent nan	öffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch ifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die des Veröfstichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genicht und der die aus einem net Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem eren besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) eren besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) eren besonderen Grund angegeben ist werden werden eren besonderen Grund angegeben ist werden eren besonderen Grund angegeben ist werden eren besonderen Grund angegeben ist werden eren besonderen Grund gegeben eren besonderen Grund des Veröffentlichung von besonderen Brund werden werden werden werden er gegeben er gegeben er gegeben eren besonderen Grund angegeben ist werden eren besonderen Grund angegeben eren besonderen Grund angegeben eren besonderen Grund angegeben ist werden eren besonderen Grund grund er gegeben eren besonderen Grund grund er gegeben eren besonderen Grund grund er grund g	edeutung; die beanspruch finderischer Tätigkeit be
ein: bez	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen einer oder mehreren anderen Veror gorie in Verbindung gebracht wird einen Fachmann naheliegend ist	und diese Verbindung fi
turr	öffentlichung, die Vor dem internetien Prioritätsdatum veröffent- , aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent- t worden ist	
IV RES	CHEINIGUNG	hambanharichte
Datu	m des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen	
	Oktober 1988	
Inter	nationale Recherchenbehörde Unterschrift des Devol mächtigten Bed	
	Sumpäischer Patentamt	FYAN DER PUTTEN

Kennzei	chnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Ansaruch Nr.
	Technical Disclosure Bulletin, Band 27,	1
IBM ·	Technical Disclosure Bulletin, Band 16, Nr. 2, Juli 1973, (New York, US), J.R. Malin: "Optical micrometer", Seiten 433-434	1
		1
• .		
•		
•		•
•		
-		
		·
		.
•		-
		1
•		
•		
	IBM  IBM	6850-6851 siehe das ganze Dokument  IBM Technical Disclosure Bulletin, Band 16, Nr. 2, Juli 1973, (New York, US), J.R. Malin: "Optical micrometer",

# ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 8800541

SA 23156

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 24/10/88 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Mit Veröffentlichung Pa		ed(er) der etfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A- 0142464	22-05-85	JP-A- US-A- CH-B-	60073405 4585349 663466	25-04-85 29-04-86 15-12-87
GB-A- 2144537	06-03-85	FR-A,B DE-A-	· 2550332 3428593	08-02-85 14-02-85